# 業 解説

# フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ波の発生と応用

萩行正憲,谷 正彦<sup>1)</sup>,北原英明<sup>2)</sup>,長島

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター,1)福井大学遠赤外領域開発研究センター

2)大阪大学大学院工学研究科原子分子イオン制御理工学センター

(原稿受付:2008年9月12日)

ここ十年ほどの間にテラヘルツ波技術は格段の進歩を遂げ,産業応用を含めた様々な応用が提案されている.この解説では、フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ波の発生・検出の基本原理とその分光・イメージン グ応用について紹介する.特に、将来の気体プラズマ計測への応用を意識しつつ、固体プラズマの測定例につい て詳述する.

#### Keywords:

terahertz wave, femtosecond laser, terahertz time-domain spectroscopy, imaging, tomography, plasma

## 1. はじめに

つい10年ほど前までは未開拓電磁波と呼ばれていたテラ ヘルツ波は、現在最も急速な発展を遂げている電磁波領域 であり、多くの研究者がこの分野に参入しつつある. テラ ヘルツ波とは一般的には、0.1~10 THzの電磁波を指し、電 波と光の間の周波数領域にあって従来は発生、検出とも困 難とされていた領域である.図1に、電磁波の周波数、エ ネルギー, 波長の関係を示す. 3 THz は波長 100 µm に対応 する.この周波数領域では、伝統的にエネルギーは波数単 位 cm<sup>-1</sup>で表されることが多いが, 3 THz は 100 cm<sup>-1</sup> に対 応する.また、テラヘルツ波領域はいわゆる従来の遠赤外 領域にほぼ対応する.この領域は学術的には戦前からの長 い研究の歴史があり、深い物理学的研究がなされていた が、光技術のように大衆化しはじめたのはごく最近であ る. その理由は、フェムト秒レーザーをはじめとする近赤 外領域のレーザーを用いてテラヘルツ波を発生することが 可能になり、レーザーを扱う感覚でテラヘルツ波測定がで きるようになったからである. レーザーを用いてテラヘル ツ波を発生する手法としては,用いるレーザーにより,

フェムト秒レーザー,ナノ秒レーザー,および,連続発振 レーザーによるテラヘルツ波発生に分類できるが,ここで は,世界的に最も普及しているフェムト秒レーザーによる 発生について述べる.他の手法については文献を参照され たい[1,2].

健

**表1**に様々な物質のテラヘルツ波領域での励起について まとめた.半導体では自由キャリヤやフォノンの励起,誘

表1 テラヘルツ領域の様々な励起.

Material	Excitation
Semiconductor	Free carrier, Phonon, Plasmon, LO phonon-
	plasmon coupled mode, Cyclotron reso-
	nance, Magnetoplasma
Ferroelectrics	Soft mode
Superconductor	Superconducting energy gap, Quasiparti-
	cle excitation, Intrinsic Josephson plasma,
	2D-super carrier plasmon-polariton
Photonic crystal	Photonic band
Liquid	Relaxation mode
Gas	Rotational mode, Plasma
Biomolecule	Vibrational mode, Collective excitation re-
	lated to biological function



Generation and Applications of Terahertz Waves Generated by Femtosecond Lasers

HANGYO Masanori, TANI Masahiko, KITAHARA Hideaki and NAGASHIMA Takeshi

corresponding author's e-mail: hangyo@ile.osaka-u.ac.jp

電体では相転移に関係するソフトフォノンモード,超伝導 体では超伝導エネルギーギャップや高温超伝導体特有の固 有ジョセフソンプラズマ,液体では構成分子の緩和モー ド,気体では回転モード,また,生体では生理機能に密接 に関連した低振動モードなどが存在し,非常に多様性に富 んでいる.

少し前までは、フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ 波の発生とその応用について解説を書くとすると、技術を 中心に紹介し、いくつかの応用例をあげれば済んだのであ るが、現在は、応用も進化しており限られた紙数で全体の 解説を書くのは至難の業となっている.ここでは、読者が 核融合プラズマ研究に従事されていることを念頭に置きつ つ、基礎的なことがらを紹介したい.前半はプラズマ計測 に応用したい読者を想定し、テラヘルツ波の発生・検出原 理、分光法、ドープされた半導体(固体プラズマ)への適 用についてやや詳細に述べる.後半では、テラヘルツ技術 が一般にどのように利用できるかについて紹介する.

# フェムト秒レーザーを用いたテラヘルツ波の 発生と検出[1-3]

フェムト秒レーザーを励起に用いてテラヘルツ波を発生 する手法には何種類かあるが、ここでは比較的弱いレー ザーパワーでも効率的にテラヘルツ波を発生できる光伝導 アンテナを用いた手法を紹介する.図2は、フェムト秒 レーザーを用いたテラヘルツ波の発生・検出システムであ る.このシステムの要は光伝導アンテナ(光伝導スイッチ、 オーストンスイッチとも呼ばれる)で、テラヘルツ波の発 生と検出の両方に使われる.構造は図3に示すように、光 伝導性半導体薄膜(低温成長ガリウムヒ素がよく用いられ る)上に、狭いギャップを有する金属電極を形成したもの である.テラヘルツ波発生の場合は、この素子の電極にバ イアス電圧をかけ、ギャップ部を半導体のエネルギー ギャップ以上のエネルギーを有するフェムト秒レーザーパ ルス(パルス幅 100 fs 以下)で励起する.このレーザーパ

ルスにより光キャリヤが瞬時に生成され、バイアス電場に より加速される.マックスウェル方程式によると、この過 渡的電流により電磁波が空中に放射され、その遠方界での 電界は電流の時間微分に比例する  $(E(t) \sim dJ(t)/dt, \mathbf{22})$ 右下の挿入図参照).電流は1ps以下で立ち上がるので,時 間幅がピコ秒以下の電磁波パルスが放射されることにな る.この電磁波パルスは空中を伝播後、放物面鏡により検 出用の光伝導アンテナに絞り込まれる.一方,励起光の一 部は半透鏡により分けられ、時間遅延回路を通過後、検出 用の光伝導アンテナのギャップ部に照射される. この照射 により短時間の間キャリヤが生成されるが、このキャリヤ は空中を伝播してきた弱いテラヘルツ波の電場により加速 され、電流として取り出される.フェムト秒レーザーは通 常100 MHz 程度の繰り返し数であり, いくつものパルスの 積算による電流が計測されることになる.時間遅延回路を ゆっくり走査するとテラヘルツ波の電場波形が得られる. このシステムでは、検出素子の冷却などはいっさい必要な い. 従来のテラヘルツ波測定では、検出器にボロメーター を用いているため液体ヘリウムによる冷却が必要であり, また,電場波形ではなく,エネルギー(電場の二乗)が得 られるのみであった. テラヘルツ波は光と電波の境界領域 といわれるごとく、図3に示される光伝導アンテナからの 放射のスペクトルは、電波の放射のように電極の形状(ア ンテナ形状)に大きく依存する.図3のボウタイ型は低周 波,ダイポール型は高周波用である.この他,スパイラル 型、ログペリ型、アレイ型など、従来のマイクロ波やミリ 波領域でのアンテナ技術を応用した光伝導アンテナが考案 されている. なお, 放射されるテラヘルツ波はキャリヤの 加速方向に偏光している. 電極を多極構造にし, 印加する 電圧の方向を高速で切り替えれば、高速の偏光変調も可能 である[4].

図4は発生と検出の両方にダイポール型光伝導アンテナ を用いた場合のテラヘルツ波の典型的波形とそのフーリエ 成分(電場の二乗,つまり,強度)である.発生したテラ



図2 フェムト秒レーザーと光伝導アンテナを用いたテラヘルツ波の発生と検出.

Commentary



#### Dibo

図3 光伝導アンテナの構造.

ヘルツ波の時間幅は 0.25 ps であり,モノサイクルに近い.また,フーリエ成分は 150 cm<sup>-1</sup> (4.5 THz)にも及んでいるのがわかる.ダイナミックレンジもピークでは 6 桁を超えている.周波数帯域がブロードなので,時々,太陽光のような白色ランダム光と誤解される方がおられるが,各周波数成分の位相は決まっており,その意味ではコヒーレントな電磁波である.テラヘルツ波は,非線形光学結晶をフェムト秒レーザーで励起しても発生するが,この場合,10フェムト秒程度の時間幅のレーザーを用いると 100 THz (中赤外)を超える放射が得られる[5].

#### 3. テラヘルツ時間領域分光法の原理

時間波形が測定できることを利用したユニークな分光法 が、テラヘルツ時間領域分光法(Terahertz Time-Domain Spectroscopy, THz-TDS)と呼ばれるものである[3]. **図5** はその原理を示したものである.試料は厚さ*d*の平行平板 で、その複素屈折率を $\hat{n}(\omega) = n(\omega) - i\kappa(\omega)$ とする.ωは角 周波数である.実部*n*は通常の屈折率で、虚部*κ*は消衰係 数と呼ばれ減衰に対応している.入射テラヘルツ波*E<sub>r</sub>(t)* は試料により反射や吸収を受けながら透過するが、多重反 射も含めた透過後の波形を*E<sub>s</sub>(t)*とする.この波形の一連 のデータ処理プロセスを**図5**中に示した.まず、波形の複 素フーリエ成分を計算し、両者の比をとると複素振幅透過 率が得られる.この量は、振幅 $\sqrt{T(\omega)}$ (*T* は通常のパワー 透過率)と位相シフト $\phi(\omega)$ で表されるが、多重反射も考慮 して試料の複素屈折率 $\hat{n}(\omega)$ の関数で表すことができる.



図5 テラヘルツ時間領域分光法におけるデータ処理過程

屈折率  $\tilde{n}(\omega)$  を求めることができる.物質の複素比誘電率  $\tilde{\epsilon}(\omega)$  と複素屈折率は  $\tilde{\epsilon}(\omega) = \tilde{n}(\omega)^2$ の関係がある(比透磁 率  $\mu = 1$  を仮定)ので,非接触測定でテラヘルツ領域の複素 誘電 率 が 得 ら れ る こ と に な る.な お,吸 収 係 数 は  $a(\omega) = 2\omega\kappa/c$  で与えられる (c は光速).半導体などでは, 複素電気伝導度  $\tilde{\sigma}(\omega)$  を求めたいことがあるが,この場合 は、 $\tilde{\epsilon}(\omega) = \epsilon_{\infty} - i\tilde{\sigma}(\omega)/\omega\epsilon_{0}$ の関係を利用する.ここで、 $\epsilon_{\infty}$ は十分高周波での比誘電率、 $\epsilon_{0}$  は真空の誘電率である.

この分光法のユニークな点は,通常の分光法では広い周 波数領域での測定を行い,クラマース - クローニッヒ変換 により誘電率の実部と虚部を求めるのに対し,各周波数で 一挙に両者が求まることである.また,試料の光励起後の 高速の時間変化を追跡したい場合,テラヘルツ波発生に用 いているフェムト秒レーザーパルスをまず試料の励起に用 い、その後発生させたテラヘルツ波パルスの遅延時間を変 えて試料のプローブに用いる,光ポンプ - テラヘルツ波プ ローブの実験が可能である[6].この超高速分光法は, THz-TDS であるからこそ可能なもので,通常のフーリエ 変換遠赤外分光法(FT-FIR)では不可能である.さらに,光 源は点光源に近いので,FT-FIR の光源である高圧水銀灯 に比べて小さく絞ることができ,小さな試料を測る場合, あるいは,高空間分解のイメージングに有利である.



図4 ダイポール型光伝導素子を放射と検出に用いた場合の(a)テラヘルツ波形と(b)パワースペクトル.

#### 4. ドープされた半導体への応用

ドープされた半導体では自由キャリヤが存在し,気体プ ラズマと同様,キャリヤの集団運動であるプラズマが電磁 波伝播を支配する.シリコンは赤外(テラヘルツ波)活性 のフォノンモードが存在しないため,テラヘルツ波領域の 電磁波応答はプラズマのダイナミクスのみに依存し,近似 的にはドルーデモデルで記述できる.ここではドープされ たシリコン (n型)の透過測定について述べる[7]. 試料は P(リン)ドープで,室温の比抵抗が 1.1 Ωcm,厚さが 400 µm である.室温でのキャリヤ密度は約 4×10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup> であ る.

**図6**に試料がない場合のテラヘルツ波形  $(E_r(t))$  と試料 挿入後の波形 (E<sub>s</sub>(t)) を示す. 測定は試料の温度を変えて 行っている.半導体では、温度の低下とともにキャリヤの 密度は減少し、その散乱時間も変化(変化の仕方は、散乱 機構に依存)する.透過波形は試料の挿入により振幅が小 さくなり、かつ、時間遅れが生ずる.詳細に見ると、波形 は試料がない場合に比べて単に小さくなっているだけでな く, 歪んでいることがわかる. 温度の低下とともに, 振幅 は一旦小さくなった後,低温では大きくなり,試料裏面と 表面で反射してきた2番目のパルスも明確に現れる.図5 に示される手順に従い、これらの波形を複素フーリエ変換 し、パワー透過率 $T(\omega)$ と位相シフト $\phi(\omega)$ を求めた結果 を、図7(a)と(b)に示す.透過スペクトルは温度に大きく 依存するのがわかる. 図7(c)と(d)はそれぞれ複素屈折率 スペクトルの実部と虚部, (e)と(f)はそれぞれ複素電気伝 導度スペクトルの実部と虚部である.物理的にわかりやす いので、電気伝導度の実部 $\sigma_1(\omega)$ について説明する. 単純 なドルーデモデルでは, 複素電気伝導度は,

$$\tilde{\sigma}(\omega) = \sigma_1(0) \frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad , \tag{1}$$

$$\sigma_1(0) = \frac{Ne^2\tau}{m^*} \tag{2}$$

で与えられる.ここで、 $\tau$ , N,  $m^*$ , e はそれぞれ、キャリ ヤの散乱時間、密度、有効質量、素電荷である.なお、半 導体中ではキャリヤの有効質量は異方性があるとともに、 n型では一般的には真空中の電子質量よりも軽くなる.n 型シリコンでは $m^* = 0.26m_e$  ( $m_e$  は電子質量) である.  $\sigma_1(0)$  は直流電気伝導度で、移動度(単位電場中でのキャリ ヤの速度)  $\mu = et/m^*$ とは、

$$\sigma_1(0) = Ne\mu \tag{3}$$

の関係がある.(1)式からわかるように,高周波数では電子は電磁波の電場についていけなくなり,図7(e)のよう に電気伝導度の実部は周波数とともに単調に減少する.低 周波数極限での電気伝導度の実部は,温度の低下とともに 一旦増加した後,低温では減少し,ついにはゼロに近くな る.これは,温度の低下とともにフォノンによるキャリヤ の散乱が減少し,(3)式中の移動度µが増大して電気伝導 度は増大するが,さらに低温になるとキャリヤが不純物に 捕えられてキャリヤ密度 N が減少することで説明ができ



図6 ドープされたシリコンに対する透過テラヘルツ波形の温度 依存性. 試料挿入前のテラヘルツ波形も示す.



 図7 図5のデータ処理過程によって導出した(a)パワー透過率,
(b)位相シフト,(c)屈折率,(d)消衰係数,(e)複素電気 伝導度の実部,および,(f)複素電気伝導度の虚部.

る. 図7 (e)と(f)をNとτ(あるいはμ)をパラメータとし てドルーデモデルでフィッティングすることにより,半導 体にとって応用上重要なパラメータであるキャリヤ密度と 移動度を,非接触かつ無磁場下(ホール効果を利用する通 常の方法では,磁場の印加が必要)で求めることができる. この手法は,プロセスプラズマ(気体プラズマ)の密度と 散乱時間を測定するのにも用いられている.[8-10]

次に磁場下でのドープされたシリコンのテラヘルツ波透 過について述べる[2,11]. 固体物理では磁場下でのプラズ マをマグネトプラズマと呼んでいる[12]. 磁場(1.5 T)は 永久磁石で印加し,方向はテラヘルツ波の伝播方向に平行 あるいは反平行で (ファラデー配置と呼ばれる),入射波 は垂直方向 (v 方向) に直線偏光している.図8に磁場がテ ラヘルツ波の進行方向に平行並びに反平行な場合の透過後 の波形を示す.この偏光方向も含めた電場の時間発展は, テラヘルツ波の波形を互いに垂直な2つの偏光で測定し, 合成して得られたものである. 偏光が時間とともに回転し ている様子がよくわかる. このような物理的にわかりやす い表示ができることも、THz-TDSの特徴である. 図8(a) と(b)を比較すると、*E<sub>x</sub>*-*E<sub>y</sub>*面への投影はともにほぼ楕円 になっているが、惰円の主軸の回転方向は磁場の向きが反 転すれば、逆になることがわかる.この波形を複素フーリ エ変換すると、各周波数での楕円率と楕円の回転角が一挙 に得られる. なお, 楕円率とは偏光の楕円の短軸と長軸の 比(直線偏光では0,円偏光では±1)であり,回転角と は楕円の主軸の角度(今の場合, y方向からの回転角)であ る. その結果を図9に示す. 図6に見られるように, 試料 を素直に透過してきた1番目のパルスと裏面と表面で反射 してきた2番目のパルスは、時間的に分離して観測され る. そこで、それぞれのパルスを時間領域の窓で切り出し て複素フーリエ変換することにより、それぞれのパルスの 楕円率と回転角のスペクトルを求めることができる. 図9 では、1番目と2番目のパルスの両者について楕円率と回 転角をプロットしているが、2番目のパルスは1番目のパ ルスに比べて, 楕円率, 回転角とも約3倍になっているの がわかる.これは、2番目のパルスは試料中を逆走してい るときも楕円率と回転角が加算されていることを意味して いる.これは,静磁場によって系の時間反転対称性が破れ たことを意味している.このようなデータ処理が可能なこ ともまたTHz-TDSの特徴である.磁場を反転すると,楕円 率と回転角の極性が反転していることもわかる.図中の実 線および破線はNとµをパラメータとした,マグネトプラ ズマに対するドルーデモデルによるフィッティングの結果 である.このフィッティングからも,Nとµを求めること ができる.すなわち,透過波の偏光状態を測定するだけで これらの物理量が求まることになる.逆に,Nとµがわ かっている場合は,この測定から磁場の強さがわかること になる.

5. テラヘルツ波を用いた分光とイメージングの例

様々な物質に対するテラヘルツ波の透過特性はどうか, また,指紋スペクトルのような物質固有のスペクトルが見 えるのだろうか,というのが読者が知りたいことであると 思われる.テラヘルツ波は,紙,プラスチック,セラミッ クスなどは比較的よく透過する.反対に,水や金属は透過 しない.水へのテラヘルツ波の侵入長はわずか100 µm 程 度である.したがって,「X線の代わりになる」というよう な書き方がされている場合があるが,水でできていると いってもよい人体に対しては皮膚のごく表層にしか到達で きない.分子を念頭に置き,テラヘルツスペクトルについ



図9 第1透過パルス波および第2透過パルス波の楕円率および 回転角スペクトル.



図8 磁場を印加したドープされたシリコン基板における透過テ ラヘルツ波の偏光の時間発展.

て述べると、気体、固体(分子性結晶)、液体の吸収スペク トルは、大体図10のようになる.(a)に示されるように気 体は非常に鋭い回転スペクトルを有し、指紋スペクトルと して気体の種類の判別に利用できる.分子が集まって結晶 を作っている場合、テラヘルツ波領域では分子間振動(分 子が剛体のように形を変えずに相対的に振動している状 態)や、大きな分子では捩じれのような弱い復元力に対す る分子内振動などが現れる.この場合、(b)に示されるよ うにやや幅広いスペクトルとなる.これも指紋スペクトル として物質の同定に利用できる.液体の場合にはもはや鋭 いスペクトルは現れず, (c)に示されるようなブロードで 単調なスペクトルとなる. このような場合は, 分子や分子 クラスターの回転や並進による誘電緩和を反映していると 考えた方がわかりやすい、明確な指紋とはならないが、誘 電率の実部と虚部のスペクトルが得られ、これらのスペク トルは液体ごとに異なるので、ある程度の液体の種類の推 測は可能である。例えば、水はほとんどテラヘルツ波を透 過しないのに対し、ガソリンなどの引火性液体はある程度 透過する.ペットボトル中の液体が水やジュースか,危険 な引火性の液体かは、テラヘルツ波の透過率を測定するこ とにより、開栓せずに判別が可能である[13].

図11にL-アラニン(アミノ酸の1種), L-アラニンが少数 結合したペプチドオリゴマー,たくさん結合したポリペプ チド,および,ニワトリ卵白リゾチーム(タンパク質の1 種,タンパク質はアミノ酸が多数結合したもの)の10K



図10 (a)分子気体, (b)分子性結晶, および, (c)液体の典型的 テラヘルツ吸収スペクトル.

におけるスペクトルを示す[14]. L-アラニンおよびオリゴ マーは微結晶の集まりである. L-アラニンやオリゴマーは 比較的鋭い線スペクトルを示し、アミノ酸残基数が増える に従い線幅がブロードになる傾向がある.スペクトルは, それぞれの分子に固有で、指紋として利用できる.しかし、 ポリペプチドやニワトリ卵白リゾチームでは、振動の自由 度が莫大な数で、周波数とともに単調に増大するスペクト ルとなり、もはや指紋スペクトルとしての意味を持たな い. つまり, 巨大な分子量を有するポリペプチドやタンパ ク質分子を、テラヘルツスペクトルから同定するのはほと んど不可能である.しかし、タンパク質は環境などによっ ていくつかの形状(コンフォメーション)をとり、その違 いは吸収係数の違いとして現れる場合がある.この場合に は、テラヘルツスペクトルをコンフォメーションの同定に 使うことができる. また, 最近, タンパク質のテラヘルツ スペクトルの温度依存性や水分量依存性が非弾性中性子散 乱や準弾性散乱に類似していることから、両者はタンパク 質ダイナミクスに関して同等の情報を与えることが示唆さ れている[14].実験室レベルの小型装置であるテラヘルツ 分光装置で、大がかりな中性子散乱と同等もしくは類似の ダイナミクスに関する情報が得られるのであれば、そのメ リットは非常に大きい.

比較的小さな分子の微結晶は特有の線スペクトルを有す ることが多い. また、紙はテラヘルツ波をよく透過し、鋭 いスペクトルを持たないのが普通である. 図12(a) はプラ スチック爆弾 C-4 (RDX と呼ばれる分子が主成分)の消衰 係数スペクトル(先に、吸収係数との関係について説明し た)である[15].スペクトルには特徴的なピークが見られ, C-4の同定に使えるのがわかる.このかけらを封筒中に入 れ, 封筒の外, 封筒中のC-4片がある場所, ない場所でのテ ラヘルツ透過波形を測定したのが(c)であるが、測定する 位置によって波形と時間遅れが異なるのがわかる. (c)中 の矢印で示されるところに遅延時間を固定し、試料を移動 してイメージングを行ったのが(d)である. イメージには C-4片の形状が現れている.この測定では遅延時間を固定 しているので、形状がわかるだけであるが、各点で波形を とりながら2次元的に位置を走査すると、各位置において スペクトルにより物質を同定しつつ、形状を確認すること も可能である.このような応用は、封筒中の禁止薬物につ いても行われ、税関などで使用される実用機の開発も進め られている[16].

THz-TDS で使われるテラヘルツ波は時間幅 1 ps 以下の パルスであるので,超音波エコーあるいはリフレクトメト リーと同様に深さ方向のイメージ,つまり断層像の測定が 可能である[17].図13(a)はその原理を示したもので,試料 表面から入射したテラヘルツ波パルスは,内部構造に応じ て順次反射され,パルス系列として波形が測定される. (b)は断層像の測定に用いた高圧ケーブルの構造を示した もので,被覆が銅ケーブルを覆っている.反射型の THz-TDS 装置を用いて,表面からテラヘルツ波パルスを入射 し,反射波形を測定する.長さ方向に試料を移動してこの 波形を順次測定し,反射波の振幅を濃淡でプロットすると



図11 L-アラニン、L-アラニンペプチドオリゴマー (2量体、3量体、5量体)、ポリL-アラニン (ポリペプチド)、および、ニワトリ卵白 リゾチームの 10 K でのテラヘルツ吸収スペクトル.



図12 (a) プラスチック爆弾 C-4 の消衰係数スペクトル,(b) 測定された C-4片の写真,(c) 各位置での透過波形,および,(d) 封筒中の C-4 片のテラヘルツイメージ.

(c)のような断層像が得られる[18]. 図では,"Defect"と示 されている位置に被覆のはがれが検出されている.

## 6. まとめ

フェムト秒レーザーを用いてテラヘルツ波を発生・検出 する手法とその分光,イメージングへの応用について述べ た.ドープされた半導体中では,サイズは核融合プラズマ に比べてかなり小さいものの,キャリヤの集団励起である プラズマ(固体プラズマ)が存在する.そこで,固体プラ ズマと気体プラズマの類似性を考慮しつつ,テラヘルツ波 の透過スペクトルからプラズマの密度や散乱時間を導出し た例について紹介した.また,磁場が印加されたプラズマ 中でのテラヘルツ波の透過特性が,偏光も含めてどのよう になるかを紹介した.固体プラズマについては反射波の測 定例は紹介できなかったが,高圧ケーブルについてリフレ クトメトリーにより断層イメージの取得が可能であること を示した.現在,LHDにおけるプラズマ密度分布がマイク ロ波・ミリ波領域でのリフレクトメトリーにより測定され ているが,密度がより高い国際熱核融合実験炉(ITER)で のリフレクトメトリーではテラヘルツ波を使うことが検討 されている[19,20].テラヘルツ波測定技術の気体プラズ マへの応用の研究例はまだ少ないが[8-10],将来の可能性



図13 (a)テラヘルツリフレクトメトリー(断層像測定)の原理, (b)高圧ケーブルの構造,および,(c)高圧ケーブルの断層 像(矢印は被覆が剥がれているところを示す).

を探る意味で,我々も核融合科学研究所や大阪大学原子分 子イオン理工学センターとの共同研究をスタートしてい る.ここでは触れられなかったが,プラズマとの関わりで は,高強度レーザー誘起気体プラズマからのテラヘルツ波 放射現象も最近話題になっている.これについては,文献 [21]を参照されたい.

テラヘルツ波工学の一般的な応用については、様々な提 案がなされている[22,23]. 図14に応用分野についてまと めた. 基礎物性物理や基礎化学,バイオ・医学応用,産業 応用、セキュリティなどである。テラヘルツ波技術という のは,分野横断的な技術であり,汎用な技術である.ここ 10年くらいのこの分野の発展を振り返ってみると、初めの 頃は多くの方々はテラヘルツ波とは何だろうとおずおずと 眺めておられ、少しずつ実際に研究に従事される方が増 え,最近は,異常ともいえる活況を呈してきた.あちこち で、セミナーが開かれ、様々な分野の雑誌でテラヘルツ波 技術が紹介されるという状況である. 今後, さらにこの分 野への参入者が増えると予想される.とはいうものの,ま だ、この分野の恒常的な牽引力となるキラーアプリケー ションは見つかっていない.21世紀の大事な技術であるの で,長い目で育てることが大事であると考える.なお,テ ラヘルツ技術の産業応用をめざしてテラヘルツテクノロ ジーフォーラム (http://www.terahertzjapan.com/index. html) が設立され、また、日本学術振興会の産学協力研究 委員会第182委員会「テラヘルツ波科学技術と産業開拓」が 2008年10月1日よりスタートする.前者は、会員になれば テラヘルツ波技術の最新動向や研究会などに関する情報を 常時通知してもらえる.



図14 テラヘルツ波技術の様々な応用分野.

#### 謝 辞

この研究は、多くのポスドクや学生との共同研究です. また、プラスチック爆弾の測定は、大阪府警科学捜査研究 所との共同研究によるものです.この場を借りてお礼申し 上げます.この研究の一部は、文部科学省のリーディング プロジェクト「未踏光学(テラヘルツ光学)開発・創生プ ロジェクト」および日本学術振興会の科学研究費補助金基 盤研究(S)「レーザー励起テラヘルツ波の高度応用」の援 助を受けて行われたものです.

#### 参考文献

- [1] テラヘルツテクノロジーフォーラム編:テラヘルツ技 術総覧 (NGT,東京, 2007).
- [2] 西澤潤一編著:テラヘルツ波の基礎と応用(工業調査 会,東京,2005).
- [3] 萩行正憲:分光研究 54,181 (2005).
- [4] Y. Hirota et al., Opt. Express 14, 4486 (2006).
- [5] R. Kübler et al., Appl. Phys. Lett. 85, 3360 (2004).
- [6] R. Huber et al., Nature 414, 286 (2001).
- [7] S. Nashima et al., J. Appl. Phys. 90, 837 (2001).
- [8] S. P. Jamison et al., J. Appl. Phys. 93, 4334 (2003).
- [9] B. H. Kolner et al., Appl. Phys. Lett. 87, 151501 (2005).
- [10] Z. Mics et al., J. Chem. Phys. 123, 104310 (2005).
- [11] O. Morikawa et al., J. Appl. Phys. 100, 033105 (2006).
- [12] E. D. Palik and J. K. Furdyna, Rep. Prog. Phys. 33, 1193 (1970).
- [13] T. Ikeda et al., Appl. Phys. Lett. 87, 034105 (2005).
- [14] 萩行正憲他:日本中性子学会誌「波紋」17,67 (2007).
- [15] K. Yamamoto et al., Jpn. J. Appl. Phys. 43, L414 (2004).
- [16] K. Kawase *et al.*, Opt. Express 11, 2549 (2003).
- [17] D. M. Mittleman et al., Opt. Lett. 22, 904 (1997).
- [18] 北原英明他, 電気学会論文誌 A 127, 391 (2007).
- [19] G. Vayakis et al., Nucl. Fusion 46, S836 (2006).
- [20] M. Hangyo et al., Plasma and Fusion Res. 2, S1020 (2007).
- [21] M. D. Thomson et al., Laser and Photon. Rev. 1, 349 (2007).
- [22] M. Tonouchi, Nature Photonics 1, 97 (2007).
- [23] 萩行正憲,谷 正彦:光技術コンタクト 43,173 (2005).

Commentary



#### はん ぎょう まさ のり 萩 行 正 憲

1981年京都大学大学院理学研究科博士後期 課程修了.理学博士.1981年大阪大学工学 部助手,1990年同大学超伝導エレクトロニ クス研究センター助教授,1996年同教 授.2000年同大学超伝導フォトニクス研究センター教

授,2004年同大学レーザーエネルギー学研究センター教授 (改組による),現在に至る.レーザー励起によるテラヘルツ 波の発生とその応用の研究に従事.



## たに まさ ひこ 谷 正彦

1992年京都大学大学院工学研究科物理工学 専攻博士課程修了.工学博士.1992年より 通信総合研究所関西先端研究センター(現 (独)情報通信研究機構未来 ICT 研究セン

ター)研究員,2002年大阪大学超伝導フォトニクス研究セン ター(現大阪大学レーザーエネルギー学研究センター)助教 授(准教授).2008年3月より福井大学遠赤外領域開発研究セ ンター教授,現在に至る.主としてとしてフェムト秒レー ザー励起によるテラヘルツ波発生とその分光・計測応用の研 究に従事.



# \*\*\* はら ひで あき

2004年信州大学大学院工学系研究科博士後 期課程修了.博士(理学).同年,大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター特任研 究員,2008年大阪大学大学院工学系研究科

原子分子イオン理工学センター特任研究員,現在に至る.テ ラヘルツ分光,フォトニッククリスタルの研究に従事.



ながしま長島 たけ1 健

1996年大阪大学工学研究科応用物理学専攻 博士課程修了.博士(工学).1997年1月~ 3月同大学超伝導エレクトロニクス研究セ ンター非常勤研究員,同年4月(株)関西

新技術研究所研究員,2001年大阪大学超伝導エレクトロニク ス研究センター助手,2004年同大学レーザーエネルギー学研 究センター助手(改組による),後助教,現在に至る.フェム ト秒レーザーによるテラヘルツ波の発生とその応用の研究に 従事.